

Phoenics User Conference in Japan, 2006

## Phoenics User Conference in Japan, 2006

# マイクロフルイディクスへの適用例

SHIBAURA INSTITUTE

芝浦工業大学工学部

機械工学第二学科

小野直樹(助教授)

鈴村剛史(修士1年)

吉田貴洋(修士1年)





## 内容

- 1、マイクロフルイディクスとは?
- 2、Phoenics適用例
- (1)回転流れを用いたマイクロミキサーについて
- (2)微細撥水面の摩擦抵抗について
- S 3、全体のまとめ







## 1、マイクロフルイディクスとは?

近年、携帯型のIT機器等の進歩に伴い、半導体分野で進歩した微細加工技術を用いてマイクロスケールの流体機器や流体マシンを作成する試みが拡がっている。その適用先として、

- 1) MEMS(Micro Electro-Mechanical System), Power MEMS
- 2)  $\mu$  -TAS(micro Total Analysis System)
- 3) Lab-on-a-chip
- 4) DDS(Drug Delivery System)

などがあり、その他種々開発が進んでいる。

→このようなマイクロ流体システムに関する流体工学分野のことを

マイクロフルイディクス(Microfluidics)と呼び、最近注目されている。





## 2、Phoenics適用例 その1

### (1)回転流れを用いたマイクロミキサーについて

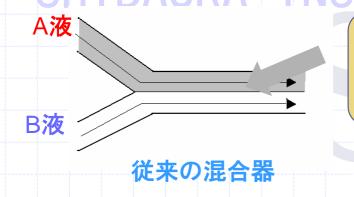
Micro mixer とは・・・ μ -TASなどで使用される、ダウンサイジングの効果を積極的に利用した微小な液混合器

#### micro化の利点

- 1. 比界面積が大きくなるため、分子拡散を効率的に行え、時間の短縮ができる。
- 2. 試薬や廃液の低減ができる。
- 3. システムの小型化が可能。

↓従来型のミキサーの典型的な例

OF TECHNOLOGY



#### 問題点

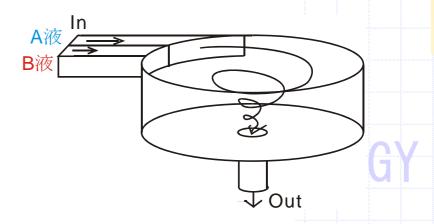
液体の混合は液一液界面の分子拡散でしか起こらず、時間がかかる。





## 数値計算の目的

- (1)新たなMixerの提案 回転流れを発生させ液ー液界面を増加させ、分子拡散による 液体の混合を促進させ既存のmixerより効率のよいmixerを提 案できないか検討する。
- (2)特性の検証 回転流れを用いたmixerの特 性を検証する。
- (3)形状の検討 回転流れを用いた混合をより 効率よく行える形状のmixerを 検討する。



ここで扱う回転流れを用いた混 合器の概略図





### 研究手法

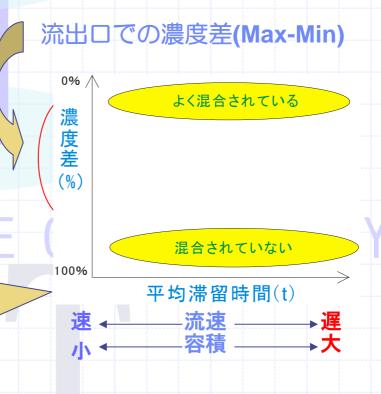
# PHOENICSを用いてシミュレーションを行い、計算結果を以下のように評価した。

#### •評価方法

Micro mixerの評価法は確立されていない。そこで独自の評価法を使用した。定常計算を行い、流出口での濃度差と圧力損失(流入口と流出口の圧力差)で評価する。流入速度を変化させ、平均滞留時間—濃度差・圧力損失のグラフを作成。

平均滞留時間とは・・・Mixerの容積に 関係なく、形状の特性について評価が できる。

$$t(m \sec) = \frac{V(mm^3)}{Q(mm^3/m \sec)}$$

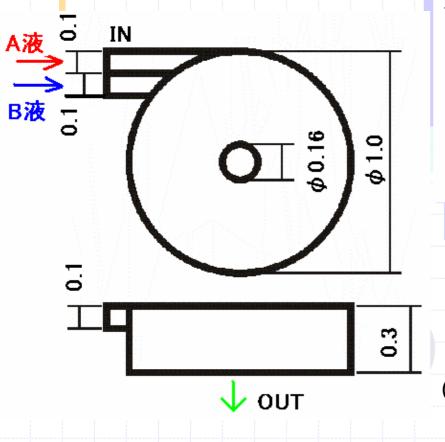




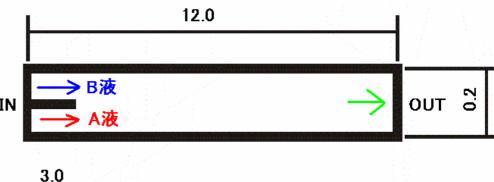


## 作成モデル 1

Standard model (本研究基本モデル)



Basic (既存のチャネル型モデル)



TUTE OF TECHN单位(m)GY

Model.2 (基本モデルの厚みを流入口の幅まで薄く したモデル)

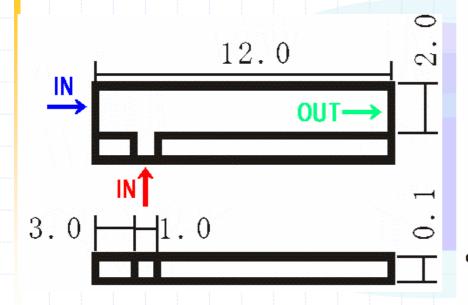
Model.3

(基本モデル流入口断面積を1/4にしたモデル)

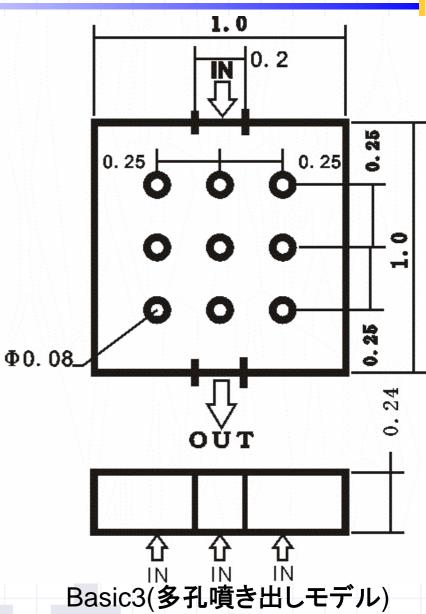




## 作成モデル 2



Basic2(噴き出しモデル)

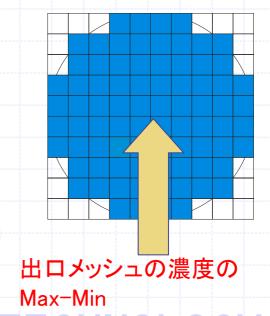






#### 計算条件

- ◆ 流入させる2流体は水とし、物性値の違いはないものとする。
- ◆ 化学変化は考慮しない。
- ◆ 流入させる流体の濃度は1、Oとし拡散係数は 液体の拡散係数の一般的なオーダーとしてア ンモニアと水の拡散係数を用いた。
- ◆ 流出ロメッシュは10×10とし、濃度の値の最大値と最小値から濃度差を求める。

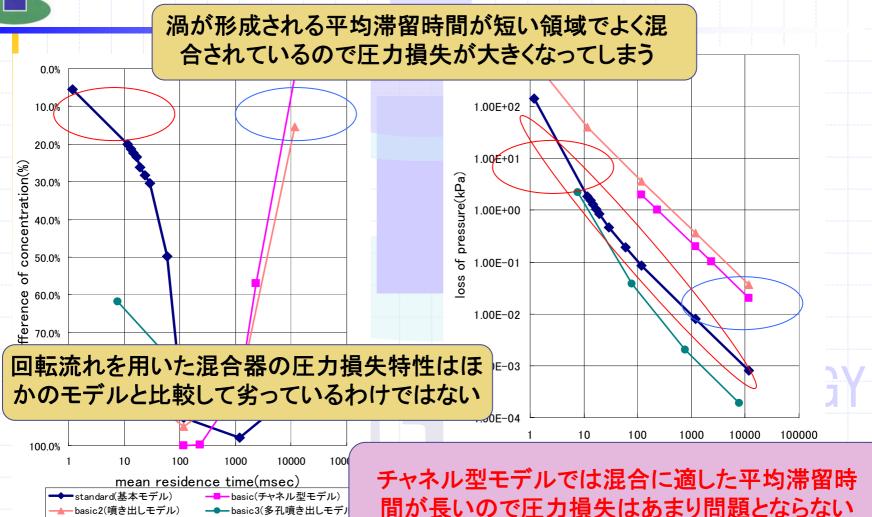


流速V(m/sec)	0.001~10.00
密度 $ ho$ (kg/m³)	998.23
動粘度 $ u$ (m $^2$ /sec)	$1.006 \times 10^{-6}$
レイノルズ数Re	0.1~1000
拡散係数D(m²/sec)	$1.23 \times 10^{-9}$

座標系	直交座標
計算モデル	Laminar(層流モデル)
繰り返し計算回数	10000回(計算結果に誤差が出 ない程度に十分長く)
計算時間	約2時間
メッシュ数	(X,Y,Z)=(60,60,15)



### 回転流れを用いたmixerと既存のmixerの比較



回転流れを用いた混合器と既存の混 合器の濃度差比較

間が長いので圧力損失はあまり問題とならない

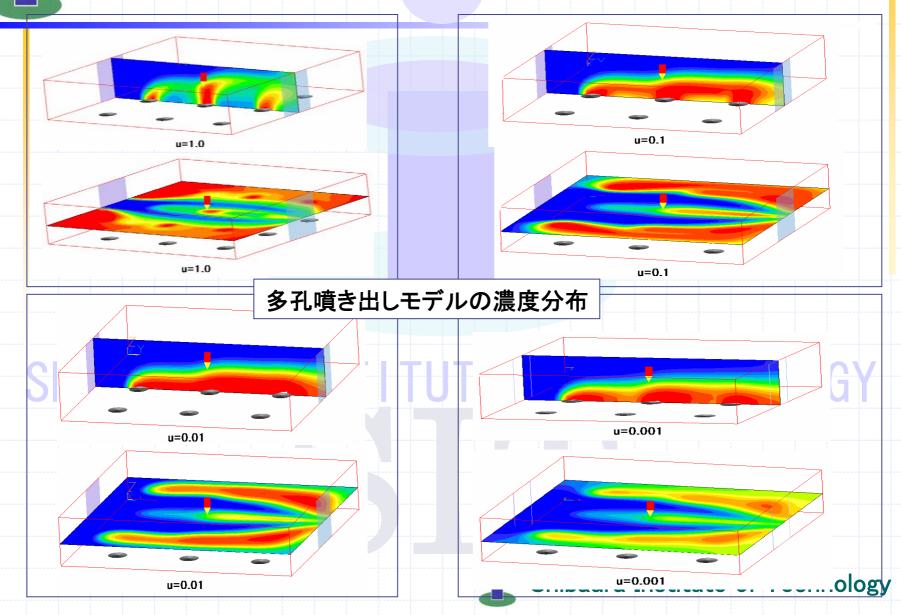
**ツエ刀摂天**ル戦



回転流れを用いたmixerと既存のmixerの比較 濃度 基本モデルの濃度分布 1.000000 0.937500 0.875000 0.812500 0.750000 0.687500 0.625000 0.562500 0.500000 0.437500 0.375000 0.312500 u = 0.1u = 10.00.250000 0.187500 0.125000 u = 1.0u=0.001 0.062500 0.000000 噴き出しモデルの濃度分布 チャネル型モデルの濃度分布 u = 10.0u = 0.1u = 0.1u = 0.001単位u(m/s) u = 0.001

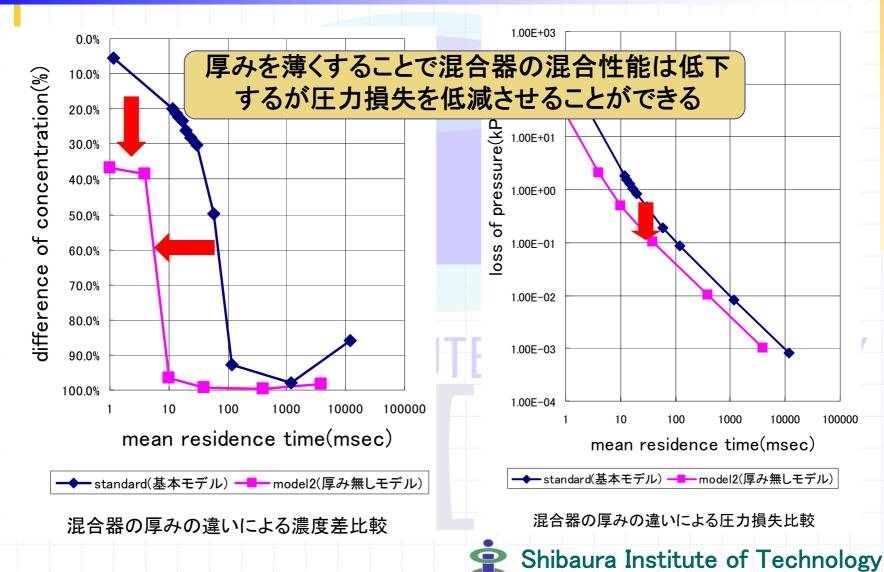


# 回転流れを用いたmixerと既存のmixerの比較



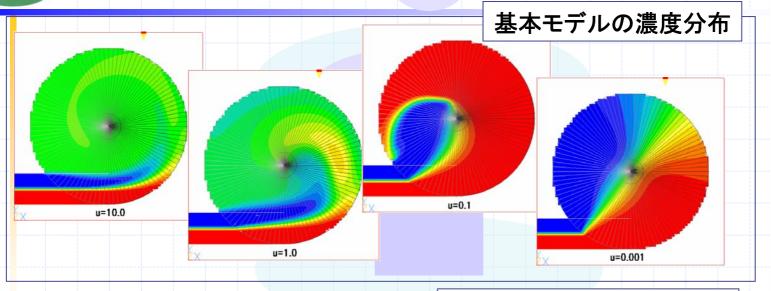


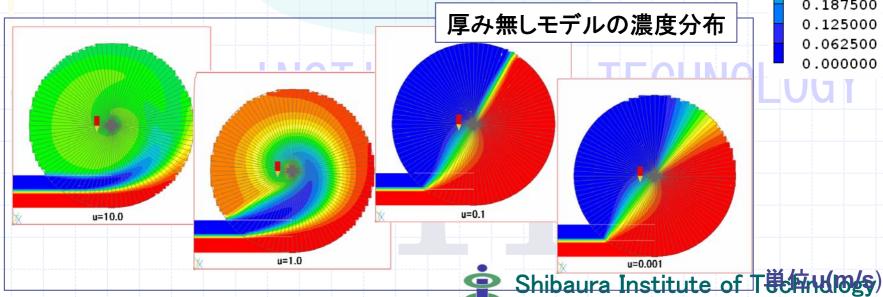
## 混合器の厚みの変化による比較





## 混合器の厚みの変化による比較





#### 濃度

1.000000

0.937500

0.875000

0.812500

0.750000

0.687500

0.625000

0.562500

0.500000

0.437500

0.375000

0.312500

0.250000

0.187500

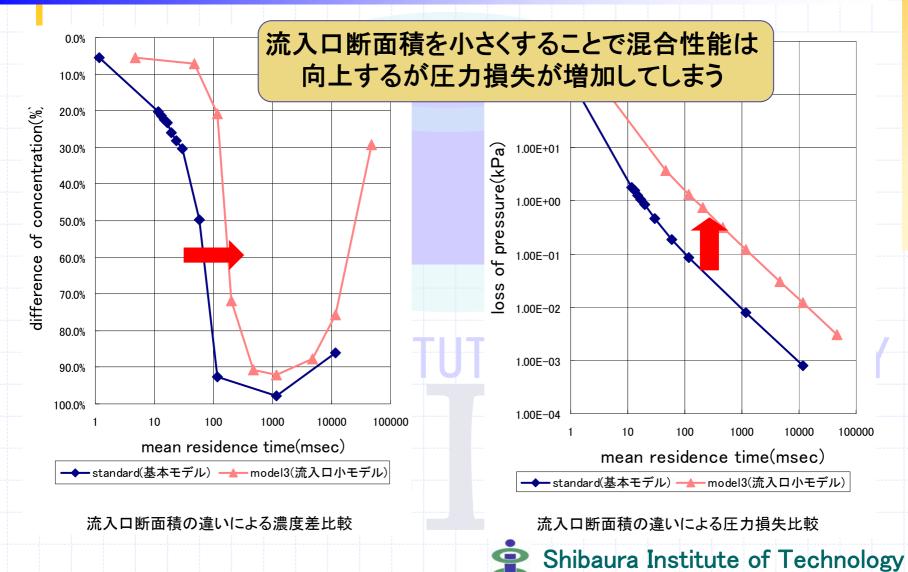
0.125000

0.062500

0.000000

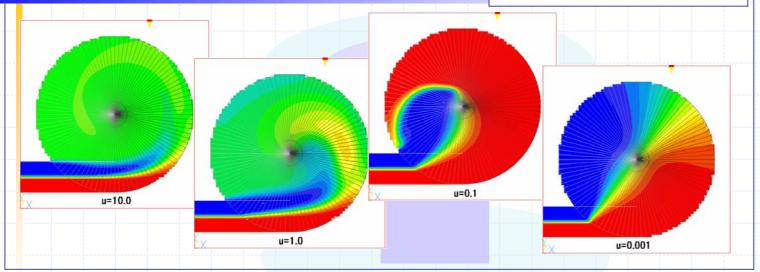


## 流入口断面積の違いによる比較



流入口断面積の違いによる比較基本も

基本モデルの濃度分布



#### 流入口小モデルの濃度分布

S INST FECHNO

u=10.0

u=10.0

Shilt u=0.001

#### 濃度

1.000000

0.937500

0.875000

0.812500

0.750000

0.687500

0.625000

-----

0.562500

0.500000

0.437500

0.375000

0.312500

0.250000

7.250000

0.187500

0.125000

0.062500

0.00000

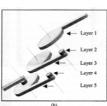
単位u(m/s) Technology

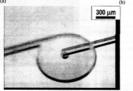


### 考察と結論

- 1. 回転流れを用いたmixerでは、一般的なmixerと比較して、 高流速域での混合が期待できる。しかし低流速域では溶 液の混合に適していない。ただし混合が期待できる領域で は圧力損失が大きくなる傾向にある。
- 2. 渦流を3次元的にし、渦の回転数を増やすため、ある程度 厚みを持たせたほうが混合効率が良い。
- 3. 流体の比表面積、渦の回転数が増えるためMixerに対して 流入口の断面積が小さいほうが効率が良い。ただし圧力 損失は大きくなる。





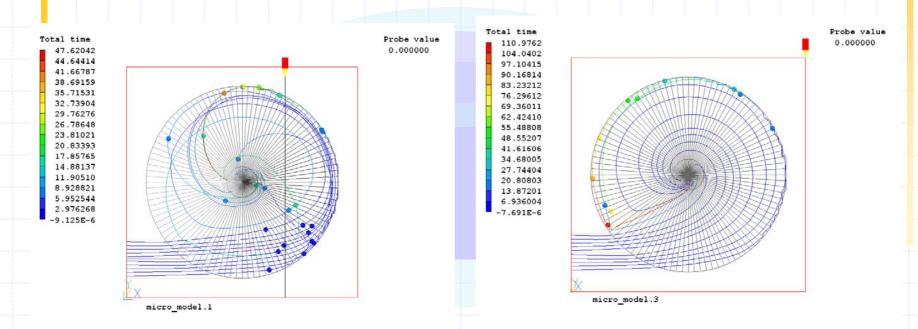


現在、フォトエッチング法にて数値モデルで 検討した左図のような形状のマイクロミキ サーをPDMS(熱硬化性シリコン樹脂)を 用いて自作している





## 流れの可視化例(流速u=1.0m/s)



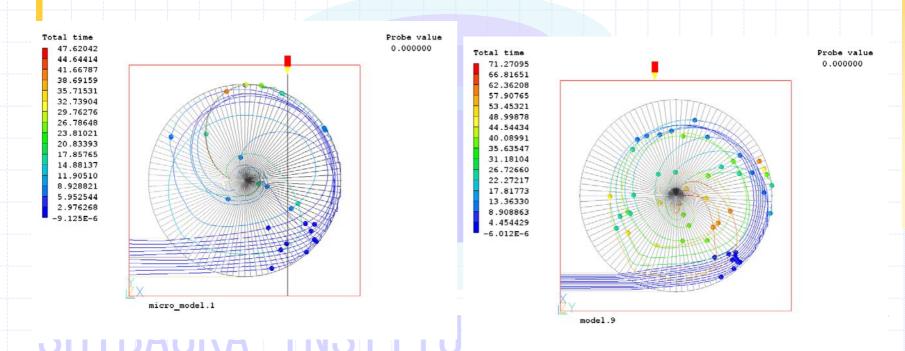
# SHIBAUKA INSTITUTE OF TECHNOLOGY Standard model

Standard model (回転流れを用いた基本モデル) Model.3 (厚み無しモデル)





# 😭 流れの可視化例2(流速u=1.0m/s)



Standard model (本研究基本モデル)

Model.3 (流入路断面積を1/4にしたモデル)



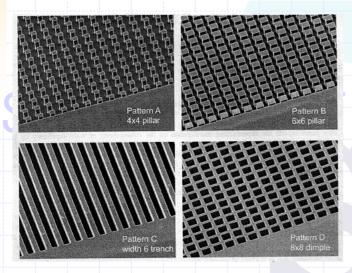


# 2、Phoenics適用例 その2

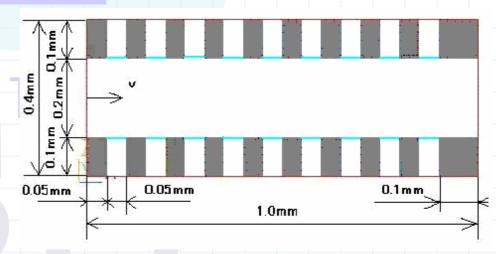
## (2)微細撥水面の摩擦抵抗について

表面張力を利用したはつ水面の研究→マイクロレベルでの加工技術 の発達により可能になる。

同様の形状をマイクロチャネル(微細流路)に活かせないかを考え、 微細流路内の壁面を表面張力で保持するモデルを作り、数値解 析を行う。



様々な形状の撥水面の作成例 (松本他、第38回日本伝熱シンポジウム)



形状の一例 面積比55% 溝長I=0.05mm の形状 Shibaura Institute of Technology



#### 数値計算の目的

微細流路における粘性抵抗の低減をめざして、 壁面摩擦損失の低減に対する、

- (1)表面張力で支持する溝長Iによる影響
- (2)一定の面積比の流路における 溝の刻み方の違いの影響

について数値モデルを用いて検討する。



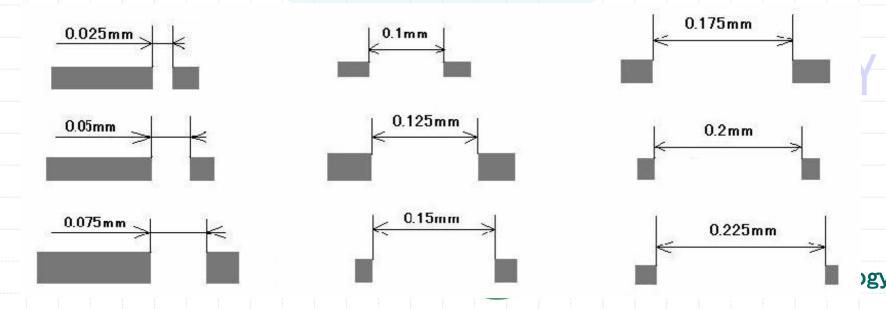


## 計算モデルその1

・溝長、位置・パターン等を変化させた2次元のモデル流路を 作成し、壁面部のせん断応力、せん断力、流速を抽出。

#### 3-1.溝長変化の計算

0.025mmから0.225mmまで0.025mm刻みで 溝長を変化させて計算。入り口流速は0.02m/sで一定。



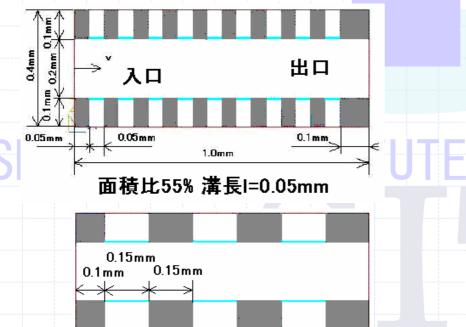


## 計算モデルその2

#### 3-2.位置・パターン変化の計算

単位流路長あたりの溝なしモデルに対する面積比を55%と80%に 固定し、55%の時は4種、80%の時は3種の流路パターンを作成、 入り口流速vを0.02m/s、0.2m/s、2m/sに変えて計算。

#### 3-2-1 面積比55%の流路モデル



面積比55% 溝長I=0.15mm



0.225 mm

面積比55% 溝長I=0.225mm



面積比55% 溝長I=0.45mm

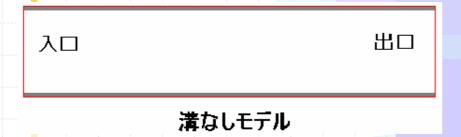
0.225mm

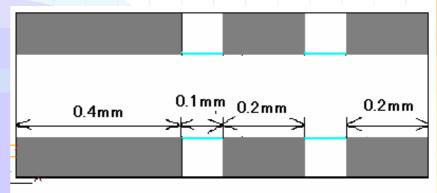
0.15 mm



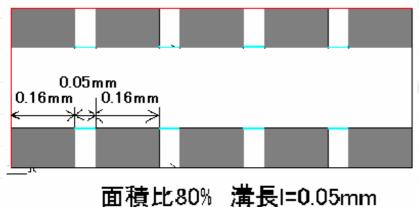
## 計算モデルその3

#### 3-2-2 面積比80%の流路モデル

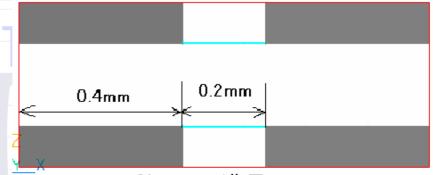




面積比80% 溝長I=0.1mm







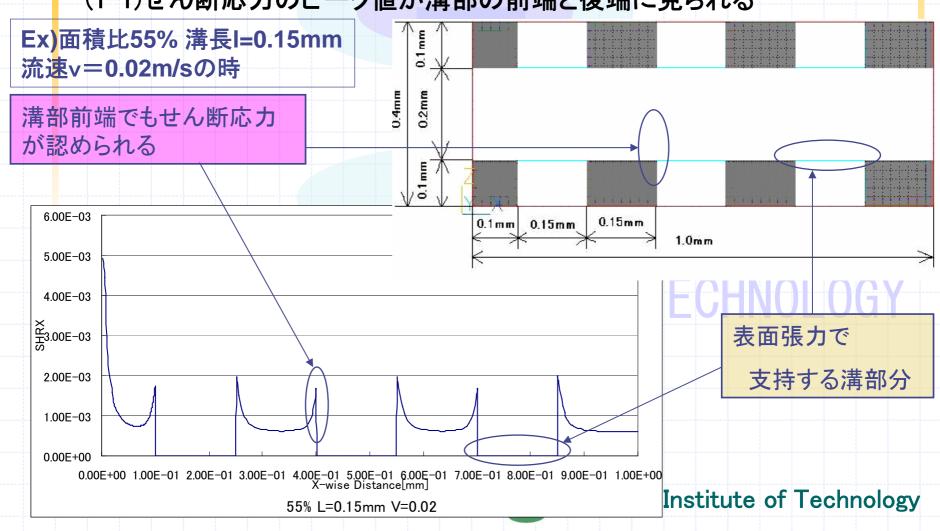
面積比80% 溝長I=0.2mm





(1)壁面部におけるせん断応力

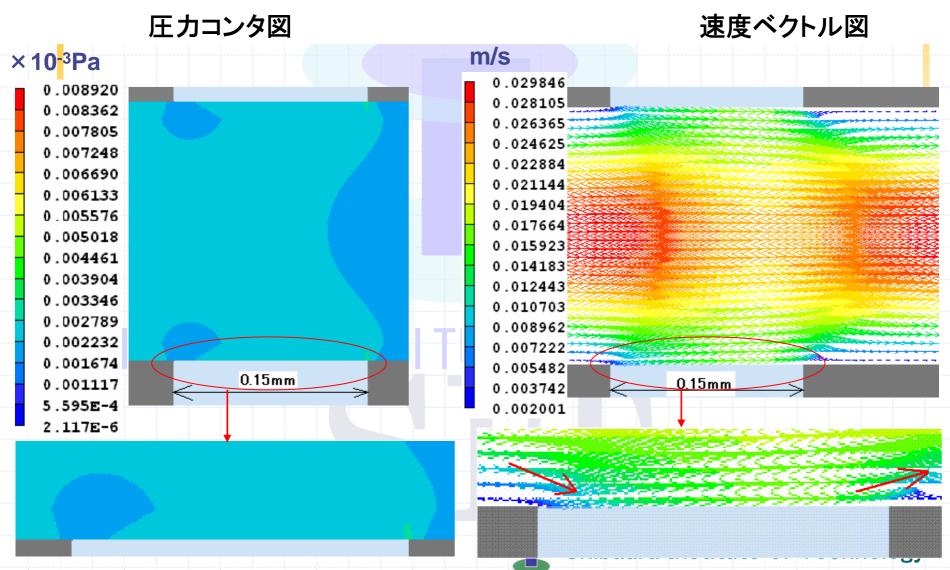
(1-1)せん断応力のピーク値が溝部の前端と後端に見られる



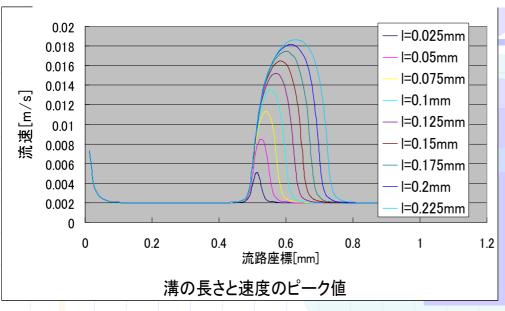
#### (1-2)溝部における圧力コンタ図と速度ベクトル図を観る

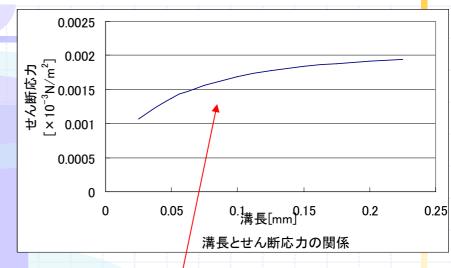
溝の前端部では圧力が下がり、流路中心部から流れが広がってくる。

また、流れ後端部では壁面部での速度の遅い流れに乗り上げ、中心部に集まる。



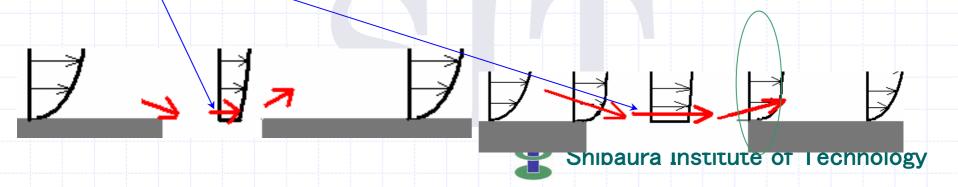
#### 【(1-3)溝長の変化によってせん断応力はどの様に変化するか





溝長Iが長くなる程 最大流速が大きくなる

最大流速が大きくなると 特に後端でせん断応力が大きくなる



#### (2)溝の位置・パターンの変化で壁面抵抗は どのように変わるか

# (2-1)溝なしモデルと溝ありモデルの壁面抵抗の差を抵抗低減率として55%と80%の各モデルについて評価

抵抗低減率 [%] = 
$$\frac{(溝ありモデルのせん断 力 – 溝なしモデルのせん断 力)}{溝なしモデルのせん断 力} \times 100$$

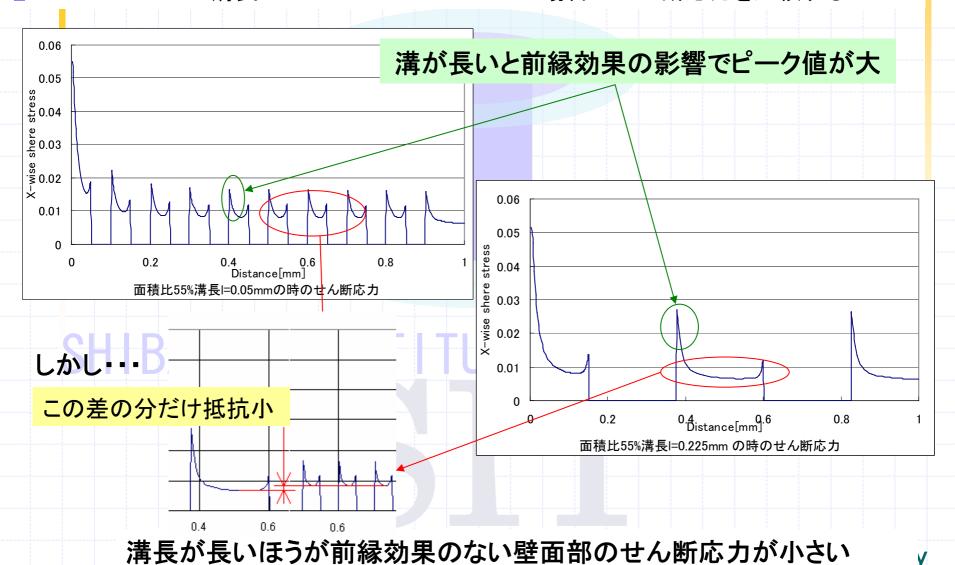
Table 1 溝長変化の場合の抵抗低減率				
	抵抗低減率 [%]			
流速[m/s] 溝長[mm]	0.02	0.2	2	
溝なし	0	0	0	
0.05	13.0	12.1	9.2	
0.15	25.6	20.1	13.5	
0.225	30.2	23.2	15.6	
0.45	36.1	28.4	19.2 🔨	
0.05(80%)	4.6	3.7	1.8	
0.1	9.6	6.7	3.0	
0.2	13.2	9.1	4.4	

面積比が同じでも・・・

溝長が長い方が 抵抗低減率が大きくなる



(2-2)なぜ溝長が長い方が抵抗低減率が大きくなるのか 面積比55%入り口流速0.2m/sの条件で 溝長I=0.05mmとI=0.225mmの場合のせん断応力を比較する





壁面抵抗をより小さくするためには

- (1)溝長の総和を大きくし、壁面が占める面積比を小さくする。
- (2)溝を小刻みにするのではなく、 溝数が少なくても各溝長を長く取る。
- →今後は、3次元形状の効果やメニスカス部分の 影響などを含めたさらなる検討が必要である。





# 全体のまとめ(個人的な意見ですが、)

Phoenics User Conference in Japan, 2006

- (1)マイクロフルイディクスの分野でのPhoenicsの 適用例を示した。
- (2)マイクロスケールの流れでの精密な流速や濃度、温度の測定は簡単ではない。数値モデルを用いて検討しておくことは非常に重要である。
- §(3)併せてマイクロスケールの実験技術、測定技術 の進歩も望まれ、数値計算と実験結果を迅速かつ 簡便に比較検討できるシステムが望まれる。

